

Предлагаемый способ изготовления интерференционного фильтра заключается в том, что наносят чередующиеся интерференционные слои сульфида цинка и фторида иттрия на две подложки в вакууме. Подложки, содержащие различное количество интерференционных слоев, закрепляются в металлическом держателе с помощью клея и герметика. Настоящее изобретение позволяет повысить стойкость фильтра к динамическим нагрузкам, без изменения заданных оптических характеристик фильтра, при ускоренном движении устройства, в котором используется фильтр.